

光計測の基礎

～光学の基礎と測定手法～



マスコットキャラクター チリン®

日時 平成29年12月8日(金) 13:00～16:30

場所 地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター(本部)
東京都江東区青海2-4-10

●ゆりかもめ「テレコムセンター」駅前

●りんかい線「東京テレポート」駅下車 徒歩15分 [朝夕無料送迎バスあり3分]
都営バス海01 テレコムセンター駅前下車

受講料 1,700円

材料の透過率や反射率は、光学的な特性を説明する重要な要素です。また、拡散性材料、多層膜材料など、その特性をもたらす現象は多岐にわたります。

材料の光学特性と特徴および原理を関連づけた理解には、散乱や干渉などの光学的な基礎知識が不可欠です。

本セミナーでは、光学にはじめて触れる技術系の方、営業系の方々を対象に、光学の基礎および測定手法に関する講義を行います。また、当センターで保有する光学測定装置をご紹介します。

セミナーを通し、光学的な現象とその原理についての理解を深め、材料の光学特性と評価方法を把握することを目的としています。

光計測に関わる多くの方のご参加をお待ちしております。

講座内容・スケジュール

時間	科目	講師
13:10～14:40	【講義】光学の基礎:光と物質の出会いが「色」を作る	有限会社テクノ・シナジー 代表取締役 田所利康氏 分光計測システム, スペクトル解析アプリケーションなどを手がける
14:45～15:30	【講義】分光測定の実理・事例紹介	東京都立産業技術研究センター 光音技術グループ 主任研究員 海老澤瑞枝 副主任研究員 磯田和貴
15:30～16:15	【講義】応用測定装置の実理・事例紹介	
16:15～16:30	【ミニ見学会】光学特性計測設備	東京都立産業技術研究センター 光音技術グループ 職員

